JAPAN PATENT OFFICE

04. 8. 2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年 7月30日

REC'D 24 SEP 2004

WIPO

PCT

出 願 番 Application Number:

特願2003-204075

[ST. 10/C]:

[JP2003-204075]

出 人

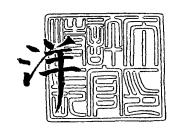
独立行政法人理化学研究所 フューエンス 株式会社

Applicant(s):

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office

9月 9 H 2004年



【書類名】

特許願

【整理番号】

PJ021689

【提出日】

平成15年 7月30日

【あて先】

特許庁長官 今井 康夫 殿

【国際特許分類】

GO1L 5/16

【発明の名称】

メカノケミカル式センサー

【請求項の数】

9

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県和光市広沢2番1号 理化学研究所内

【氏名】

山形 豊

【発明者】

【住所又は居所】

東京都渋谷区広尾1-11-5-1403 株式会社

フューエンス内

【氏名】

井上 浩三

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県和光市広沢2番1号 理化学研究所内

【氏名】

大森 整

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県和光市広沢2番1号 理化学研究所内

【氏名】

金 俊完

【特許出願人】

【識別番号】 000006792

【氏名又は名称】 理化学研究所

【特許出願人】

【識別番号】 302064588

【氏名又は名称】 株式会社 フューエンス

【代理人】

【識別番号】

100072051

【弁理士】

【氏名又は名称】

杉村 興作

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

074997

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 0216261

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 メカノケミカル式センサー

【特許請求の範囲】

【請求項1】 その表面の少なくとも一部に機能性薄膜が形成されている微小機 械構造体と、

前記微小機械構造体を支持する支持手段と、

前記微小機械構造体の機械的物性変化を検出する検出手段と、

を具えることを特徴とするメカノケミカル式センサー。

【請求項2】 請求項1に記載のメカノケミカル式センサーにおいて、

前記微小構造体は、その表面に前記機能性薄膜が形成されている第1の領域を 含み、この第1の領域は薄膜である、

ことを特徴とするメカノケミカル式センサー。

【請求項3】 請求項1または2に記載のメカノケミカル式センサーにおいて、 前記微小構造体は複数であり、それぞれ異なる前記機能性薄膜を具える、 ことを特徴とするメカノケミカル式センサー。

【請求項4】 請求項1~3のいずれか1項に記載のメカノケミカル式センサーにおいて、

前記機能性薄膜は、生体高分子、または、合成高分子である、

ことを特徴とするメカノケミカル式センサー。

【請求項5】 請求項1~4のいずれか1項に記載のメカノケミカル式センサーにおいて、

前記機能性薄膜は、エレクトロスプレーデポジション法により前記微小構造体の表面上に直接的に形成される、

ことを特徴とするメカノケミカル式センサー。

【請求項6】 請求項1~4のいずれか1項に記載のメカノケミカル式センサーにおいて、

前記機能性薄膜は、インクジェット法により前記微小構造体の表面上に直接的 に形成される、

ことを特徴とするメカノケミカル式センサー。

【請求項7】 請求項1~6のいずれか1項に記載のメカノケミカル式センサーにおいて、

前記検出手段は、前記機能性薄膜の機械的物性変化によって変位しないあるいは極めて小さい変位しか発生しない領域を持ち、

前記微小構造体は、その一端を試料溶液に浸した場合に前記領域が液面付近に 置かれる、

ことを特徴とするメカノケミカル式センサー。

【請求項8】 請求項1~7のいずれか1項に記載のメカノケミカル式センサーにおいて、

前記検出手段は、力検出センサー、および、前記機能性薄膜に張力を与えるアクチュエータを具える、

ことを特徴とするメカノケミカル式センサー。

【請求項9】 請求項1~7のいずれか1項に記載のメカノケミカル式センサーにおいて、

前記微小機械構造体は、微小片持ち梁を具えこの微小片持ち梁上に前記機能性 薄膜が形成されており、

前記検出手段は、前記微小機械構造体の微小片持ち梁の曲げ変形を検出し得るセンサーである、

ことを特徴とするメカノケミカル式センサー。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、メカノケミカル式センサーに関するものであり、特に、機能性薄膜の機械的変形を検出してこれに基づき機能性薄膜の化学反応などを検出するメカノケミカル式センサーに関するものである。

[0002]

【従来の技術】

従来、様々な微量物質によって機械特性が変化する材料が知られており、これ らの材料は微少量検出の手段として用いられている。しかしながら、従来技術で は検出機能を持つ薄膜材料を別個に製作しそれらを機械特性試験装置に取り付けることによって測定を行っていた。このため、検出機能をもつ材料を小型化する事ができず、検出速度、検出感度の点で問題を抱えていた。さらに、薄膜材料の剥離や装着時に発生する応力や歪、装着される部材との接着強度の低下などの誤差要因が多かった。

[0003]

例えば、従来技術のメカノケミカル式検出技法としては、モロゾフ他によるリガンドと高分子材料との相互作用の検出する方法(特許文献1、非特許文献1を 参照されたい。)があるが、上述した諸課題を抱えている。

また、従来技術のピックアップ方式検出技法(非特許文献2を参照されたい。)では、微細な針により機能性高分子あるいはタンパク質のサンプルを突き刺してピックアップする必要があるが、この方法ではピックアップの作業自体が極めて困難であり、また、針により貫通させた穴の周辺に応力が集中し、機能性高分子膜あるいはタンパク質膜の物性変化を正確に捉えられない(即ち、検出シグナルが小さくなる)という問題を抱えていた。また、微少物質を含む溶液などの被検出媒体の量も多く必要であった。加えて、機能性材料の交換に手間と時間がかかり、機能性材料の設置位置のバラツキなどによって再現性が低く、さらに、多種類の検出用機能性材料を同時に使用する事は困難であった。

[0004]

さらに、微小な機械物性変化を検出する力センサーもその装置の構造上から、 大型のものを使用せざるを得ず、サイズ効果を鑑みると検出感度には限界があった。また、微細構造体を用いたバイオセンサーとしては、自己組織化単分子膜(SAM: Self-Assemble Monolayer)を利用した研究例 (非特許文献3を参照されたい。)が報告されているが、単分子膜を利用しているため、極めて検出シグナルが小さく、実用的な感度は得られていない。

[0005]

【特許文献1】

モロゾフ他著「リガンドと高分子材料との相互作用の検出」(Detection of 1 igand Interaction with polymeric material、米国特許第6,033,913号、発明者

:Victor Morozov and Tamara Morozova、特許出願人: New York University) 【非特許文献 1】

モロゾフ他著 (Victor N. Morozov and Tamara Ya. Morozova, Mechanical De tecition of Interaction of Small Specific Ligands with Proteins and DNA in Cross-Linked Samples, Analytical Biochemistry 201, pp.68-79 (1992))

【非特許文献2】

山形他著「マイクロ蛋白質フィルムのメカノケミカル効果を用いた新バイオセンサー」 (A new biosensor using mechano-chemical effect of micro protein film, Y. Yamagata, V. N. Morozov, K. Inoue, J. Kim, H. Ohmori, T. Higuchi, The Seventh World Congress on Biosensors 2002 Abstract Book, Al. 07 (2002))

【非特許文献3】

フリッツ他著(J.Fritz, M.K.Baller, H.P.Lang, H.Rothuizen, P.Vettiger, E.Meyer, H.J.Guntherodt, Ch.Gerber, J.K.Gimzewski, Translating Biomeolec ular Recognition int Nanomechanics, Science, vol. 288, pp. 316-318, April (2000))

[0006]

【発明が解決しようとする課題】

従って、本発明は、上述した諸課題を解決したメカノケミカル式センサーを提供することを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】

本発明によるメカノケミカル式センサーは、

その表面の少なくとも一部に機能性薄膜が形成されている微小機械構造体と、 前記微小機械構造体を支持する支持手段と、

前記微小機械構造体の機械的物性変化(伸縮、歪、弾性定数や応力の変化などの物性変化の少なくとも1つ)を検出する検出手段(力センサー、光学式変位検出器、非接触式変位検出器など)と、

を具えることを特徴とする。

本発明によれば、検出された機械的変形に基づき機能性薄膜の化学反応等を検

出することができる。また、予め機能性薄膜が一体化して形成された微小機械構造体を使用するため、機能性薄膜と微小構造体との接合強度が高く、より高い検出シグナルが得られ、より測定精度や測定感度を向上させることができる。換言すれば、微小量検出機能を持つ機能性薄膜を成膜したそのままの状態で本センサーに装着することができるため、従来のような成膜、剥離、装着という2段階の操作が不要となりこの剥離・装着の際に発生する膜内部に発生する応力などの影響を皆無にすることができるため、極めて高精度かつ高感度に測定を行うことが可能となる。

[0008]

また、本発明によるメカノケミカル式センサーは、

前記微小構造体は、その表面に前記機能性薄膜が形成されている第1の領域と、前記支持手段に支持される第2の領域とを含み、前記第1と第2の領域とは離間されており、前記第1の領域は薄膜である、

ことを特徴とする。

本発明によれば、第1の領域をできる限り薄い薄膜にすることで、機能性薄膜の機械的物性変化を高感度かつ高精度で検出することができる。さらに第2の領域を第1の領域から離間することで、第1の領域に存在する機能性薄膜への影響を抑えることが可能となり、測定精度や測定感度をさらに向上させることができる。即ち、構造体を支持するときに前記機能性薄膜が形成されていない第2の領域で支持することにより、表面に形成されている機能性薄膜の機械的物性に変化を与えることが少なくすることができ、さらに測定精度を向上させることもできる

[0009]

本発明によるメカノケミカル式センサーでは、前記微小構造体は複数であり、 それぞれ異なる前記機能性薄膜を具えることが好適である。複数の異なる機能性 薄膜を利用することで、未知の物質を1つまたは複数含む試料溶液の測定・定量 を一回の操作で実施することが可能となる。

また、本発明によるメカノケミカル式センサーでは、前記機能性薄膜は、生体 高分子(例えば蛋白質など)または合成高分子(例えば機能性樹脂、合成繊維、 合成ゴムなど)を用いることが好適である。しかしながら、微小構造体の薄膜形成領域で成膜し、ある程度の結合力で当該領域表面に固定され得るものであって、標的物質と何らかの反応を起こす物質であれば、その他の物質(金属や無機物質など)でも使用し得る。

[0010]

さらにまた、本発明によるメカノケミカル式センサーは、

前記機能性薄膜は、エレクトロスプレーデポジション(ESD)法により前記 微小構造体の表面上に直接的に形成される、

ことを特徴とする。

本発明によれば、ESD法は、成膜時に加熱が必要なくあらゆる温度範囲で成膜が可能なため、成膜時に膜の材料である機能性材料(蛋白質)などの機構的活性や生物学的活性を何ら損なうことがないため、さらに、測定感度・測定精度を向上させることができる。

[0011]

さらにまた、本発明によるメカノケミカル式センサーは、

前記機能性薄膜は、インクジェット法により前記微小構造体の表面上に直接的に形成される、

ことを特徴とする。

インクジェット法は、装置が安価であり成膜の再現性も高いなど様々な利点がある。また、インクジェット法およびESD法は極めて薄い薄膜を再現性良く作製できる。

[0012]

さらにまた、本発明によるメカノケミカル式センサーは、

前記検出手段は、前記機能性薄膜の機械的物性変化によって変位しないあるいは極めて小さい変位しか発生しない領域(「てこ」の支点として作用する部分、例えばヒンジ部など)を持ち、

前記微小構造体は、その一端を試料溶液に浸した場合に前記領域が液面付近に 置かれる、

ことを特徴とするメカノケミカル式センサー。

本発明によれば、変位が少ない領域が試料溶液の液面付近に置かれることによって、試料溶液による表面張力や水面変動による外乱が除去あるいは低減され、より測定精度を向上させることができる。

[0013]

さらにまた、本発明によるメカノケミカル式センサーは、

前記検出手段は、力検出センサー、および、前記機能性薄膜に初期張力などの 張力を与えるアクチュエータを具える、

ことを特徴とする。

[0014]

さらにまた、本発明によるメカノケミカル式センサーは、

前記微小機械構造体は、微小片持ち梁を具えこの微小片持ち梁上に前記機能性 薄膜が形成されており、

前記検出手段は、前記微小機械構造体の微小片持ち梁の曲げ変形を検出し得るセンサー(光てこセンサー、レーザ干渉計など)である、ことを特徴とする。

[0015]

上述したように本発明の解決手段をセンサー即ち装置として説明してきたが、 本発明はこれらに実質的に相当する方法としても実現され得るものであり、本発 明の範囲にはこれらも包含されるものと理解されたい。

例えば、本発明によるメカノケミカル式検出方法は、

微小機械構造体の表面の少なくとも一部に機能性薄膜を形成するステップと、 前記微小機械構造体を支持する支持ステップと、

センサーを用いて前記微小機械構造体の機械的物性変化(伸縮、歪、弾性定数 や応力の変化などの物性変化の少なくとも1つ)を検出する検出ステップと、を含むことを特徴とする。

[0016]

【発明の実施の形態】

はじめに、本発明の原理および作用を詳細に説明する。

本発明では、機能性材料を予め用意された微小構造体上に一体となるように形

成する事で、機能性材料の小型化、微小化を図ると共にその取り扱いを容易にさせ、検出速度・感度の向上、被検出媒体の微少化、多数のサンプルによる同時検出を可能とするものである。微小構造体を利用することで、サイズ効果により極めてコンプライアンスの低い弾性変形部を利用しても共振周波数を高く保つことが可能なため機能性薄膜の機械物性変化を高感度かつ高精度に検出可能である。

[0017]

さらに、機能性薄膜を微小構造体上に直接形成することで、微小構造体との接合部の強度を大幅に高めることが可能となりより大きな検出シグナルを得ることが可能となる。さらに、機能性薄膜の形成手法として、エレクトロスプレーデポジション法やインクジェット法などを使用することで、単分子膜に比較して厚い (100nm~数 μ m) 薄膜を形成可能なため、大きなシグナルを得ることが出来る

[0018]

以下、諸図面を参照しつつ本発明の実施態様を詳細に説明する。

図1は、本発明によるメカノケミカル式センサーに使用される一体型微小構造体(検出器本体)の構造を示す図である。図の上側(斜視図)に示すように、検出器本体(一体型微小構造体)10は、本体へ取り付けを行う支持部11とそれに弾性ヒンジ12を介して接続された2個のアーム14a, bより構成される。2個のアームのうち一方のアーム14aは、アクチュエータに接続され、他方のアーム14bは微小力センサーに接続される。2個のアームの下端に繋がる薄膜形成領域16は図の下側(側面図)に示すように厚さが1から10μm程度(長手方向には約100~1000μm)と薄くなっており、ここに機能性高分子/タンパク質チップ、即ち機能性薄膜18が結合されている。チップと検出器本体との結合は、エレクトロスプレー法などにより直接結合させることも可能であるが、カルボキシルメチルデキストランなどのような固定化材を事前に塗布しておいてもよい。弾性ヒンジ部12は幅が1から10μm程度と厚さに比べて薄くできており、正面図で平面内の方向への剛性は非常に低いが平面と垂直な方向の剛性は大きくなっており2個のレバーをタンパク質膜の長手伸縮方向へのみ動かすことができる。これにより、膜のねじれ等による影響を最小限にすることができる

。また、両アーム14は各々薄膜形成領域16の両端(ここが力点となる)に接続しており、この両端が力点、アーム14はてこ(レバー)、弾性ヒンジ12が支点としてそれぞれ機能する。そして、アーム14の上部はセンサー(図示しない)やアクチュエータ(図示しない)に接触し、その箇所が作用点として機能し、薄膜形成領域16上の機能性薄膜18の機械的物性変化を感度よく測定し得る構成となっている。

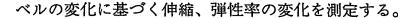
[0019]

図2は、図1に示した一体型検出器を用いた本発明によるメカノケミル式センサーの基本構成を示す図である。

図に示すように、メカノケミカル式センサー100は、ベース110、検出器取り付け部(支持手段)120、一体型検出器(検出器本体)130、微小力センサー140、圧電アクチュエータ150、微動ステージ152、およびフローセル160を具える。また、一体型検出器130は、ベース110の取り付け部120によって支持されている。一体型検出器130は、圧電アクチュエータ150と接触させてあるアーム134aと、微小力センサー140と接触させてあるアーム134bと、薄膜形成領域136と、この薄膜形成領域の表面上に形成されている機能性薄膜(この例ではタンパク質膜を用いる)138とを具える。図示はしないが、本センサーは、検出した信号をデジタル値に変換するA/DコンバータやDSPまたは検出結果をグラフとして表示するディスプレイ、測定結果を格納する記憶装置、アクチュエータや微動ステージや微小力センサーなどを制御する制御器なども具える。

[0020]

一体型検出器 130 支持される部分は比較的大きく($1\sim5$ mm程度)かつ強度も優れているためにピンセットなどで保持して容易に取り扱うことが可能となっている。圧電アクチュエータ 150 は 1 から 100 μ m程度の変位を発生可能な素子で、分析過程でタンパク質膜に伸縮振動を与え、弾性率を測定するために使用される。力センサー 140 はおよそ 1μ N以下の分解能を持ち、タンパク質膜の伸縮によって発生した力を右側のアーム(レバー)を介して検知することによって、機能性高分子膜/タンパク質膜と標的物質の結合によって生じた分子レ



[0021]

図3は、一体型検出器のフローセル部分(水面変動力の低減効果)の構成をさらに詳細に示す図である。

検出器の先端部分である薄膜形成領域136および機能性薄膜(蛋白質チップ)138は、標的物質を含んだ溶液を流すフローセル160に浸される。フロー セル160には通常pHを一定に保つためのバッファー溶液とこれに標的物質を 含ませた溶液を交互に流し標的物質による反応が発生するかどうかを検査する。 この際に、溶液を送り込むポンプの脈動や、振動の影響などによりフローセル1 60の水面が変動するが、フローセル160およびタンパク質チップのサイズが 非常に小さいため面積力である表面張力の影響が大きくなり、これが信号にたい して外乱として作用するという問題があった。しかし、図示した構造の検出器で はヒンジ部分付近を水面近くになるように配置することでこの表面張力や水位変 化などの影響を最小限に押さえることができる。これは、ヒンジ132付近では レバー(アーム)の変位が非常に小さい(即ちヒンジ132が支点として作用す る)ためここに働く外力も結果として検出される力には非常に小さな影響しか与 えないためである。一般的に、機械的に弾性変形を発生する微細構造体を利用す る場合その変位が少なくなる点を水面付近に配置することで水面からの表面張力 による外乱を大幅に低減することが可能となる。図示はしないが、フローセルは 、定量で液体を供給し得る液体供給装置(ポンプなど)を具える。また、機械的 物性は、温度の影響を受け易いため、本センサー全体(少なくとも微小構造体の 機能性薄膜とアーム部)を一定の温度に保持する恒温装置などの温度制御装置(図示しない。)を具えることが好適である。

さらに、検出感度を高めるために、変位拡大機構を微小構造体に組み込むことも可能である。さらに、複数の微小構造体(即ち、複数の異なる物質の機能性薄膜)を使用する場合は、構造体別にフローセルを用意し、異なる物質や異なる濃度の試料溶液をそれぞれのフローセルに流すこともできる。

[0022]

図4は、検出器本体として使用する微小構造体の製造法(フォトリソグラフィ

+精密機械加工法)の工程を示す図である。

図に示すように、まずウエファー上に厚膜フォトレジスト(SU-8)等を塗布し、マスクを介して露光を行い、現像する。これにより微細構造体の形状がフォトレジストにより形成される。このプロセスはX線を用いたプロセスを利用することも可能である。前記のフォトレジストの構造体にニッケル、クロム等の電気鋳造を施し、構造体を形成する.このときに形成される構造体は電気鋳造により平坦度が大きく悪化するためこれを超精密研削加工法(ELID研削法など)を用いて平坦化加工あるいは必要な段差加工を行う。その後、フォトレジストを除去して完成体の微細構造体410を取り出すことで、安価に大量生産を行うことが可能となる。この方法以外にも、超精密機械加工法、放電加工法、プレス打ち抜きなどの機械加工法により直接微細構造体を形成することも可能である。

[0023]

図5に、ESD法を利用して本発明で使用する検出器本体に機能性薄膜を形成する方法を示す模式図である。機能性薄膜を微細構造体に形成する手法としては、エレクトロスプレーデポジション(ESD)法を利用することが出来る。微細構造体510の下部にはあらかじめ水溶性ポリマー(PVPなど)を塗布しておき、この上からエレクトロスプレーデポジション法により機能性高分子タンパク質などの薄膜を形成する。その後、架橋剤(グルタルアルデヒドなど)の蒸気による処理等の方法により機能性高分子を固定化する。さらにその後、水中に浸すことにより下地の水溶性ポリマー等が溶出し、独立した薄膜と一体となった微小構造体を取り出すことが出来る。カンチレバー型の微小構造体を利用する場合は、水溶性ポリマーの下地は必要ないが、同様の手法にて機能性薄膜を形成することが出来る。

[0024]

また、エレクトロスプレーデポジション法以外にインクジェット法、マイクロスタンピング法、圧電アクチェエータによる霧化器と静電気力による捕集作用を利用した方法、スポッティング法などにより薄膜を形成することも可能である。

機能性薄膜が微小構造体と結合する部位周辺に予めpoly-L-lysineやその他の 比較的高い機械的強度が得られる高分子の薄膜を形成しておくことで、結合部の 応力集中を低減することが可能となり、かつ機能性薄膜の補強をすることが出来るため、得られる検出シグナルが増大しさらに測定感度・測定精度を高めると共 に、ハンドリングをさらに容易することが可能となる。

[0025]

微小構造体の変形、即ち、機能性薄膜の張力変化、機械的物性変化を検出する 方法としては、様々な手法が存在するが、例えば前記の光てこ、レーザー干渉計 や静電容量式変位計、光学式変位系を利用する方法が考えられる。これ以外にも 微小構造体の弾性変形した部位の変形を検出することの出来るセンサーを組み込 む方法が可能である。このセンサーとしては、ピエゾレジスティブ材料や圧電材 料を利用したもの、静電容量を利用したものなどが考えられる。

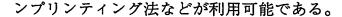
[0026]

機能性薄膜を装備した微小構造体を多数アレイ上に並べることで、異なる機能 性薄膜を用いて未知の微量物質を検出するシステムや、多数の標的物質を同時に 検出するシステムや、クローズされたマイクロチャンネルやフローセル内に設置 することで、取り扱いを容易にし、外乱の影響を少なくするシステムの構成も可 能である。

[0027]

図6は、カンチレバー(片持梁)の表面に機能性薄膜を形成した微小構造体を 用いたメカノケミカル式センサーの構成を示す図である。

図に示すように、微小構造体としてのカンチレバー610のレバー部605の表面へ機能性薄膜618をコーティングする。機能性薄膜618は自立することなく、カンチレバーの表面に固定される。この場合、機能性薄膜618の物性変化(伸縮、弾性定数の変化)によりレバー部605表面に張力が発生し、レバー部の曲がり量が変化する。この変化は、機能性薄膜618にレーザ光源からレーザを照射し、その反射光を4分割フォトダイオード630で検出する。例えば、この変化は、光てこ、ピエゾレジスティブ検出器、レーザー干渉計などによって検出する。微小カンチレバーの材料としては、シリコン、金属のほかにプラスチック材料を用いることも出来る。カンチレバーのレバー部表面への機能性薄膜の形成は、エレクトロ/スプレー・デポジション法やインクジェット法、スクリー



[0028]

図 7 は、本発明によるメカノケミカル式センサーで α - lactal buminを検出したときの検出シグナルを示すグラフである。

カンチレバー型の微小構造体としてエポキシ系フォトレジスト(MicroChem S U-8)を用いて構造体を形成し、その表面に導体化のために金の薄膜を蒸着し、さらにその上にエレクトロスプレーデポジション法により蛋白質(α -lactalbum in)薄膜を形成した。このカンチレバーの下方より「光てこ方式」にて変位をモニターしつつ、純水、バッファー溶液(HEPES)、カルシウム溶液を滴下することにより検出シグナルを得た。

また、ブランクテストとして、図8は、蛋白質薄膜を形成しない状態での同様の実験結果を示すグラフである。

図7に示すように、蛋白質薄膜が持つ検出器の場合は、カルシウムイオンによる反応、即ち蛋白質と当該イオンとの間の化学結合(即ち何らかの相互作用)を示すシグナルが得られており、一方、ブランクテストの図8では何ら目立った信号の変化が無いことから、本センサーで微量物質を検出し得ることがわかる。

[0029]

本発明による装置は、機能性薄膜と液体中、気体中の物質との特異的化学反応により、液体、気体中の微少物質の検出、定量、分析あるいは光、温度、放射線などの環境変化の検出、定量、分析に用いられる。主な応用分野としては、製薬、医療のための生化学分析、生化学および分子生物学での微少有機物質、タンパク質等の分析、化学、生物プラント、農業などでの水質検査、生成物資濃度定量管理などに使用可能である。また、空気中の微量ガスの検出、光や温度、放射線等の環境変化の測定にも使用できる。

[0030]

本明細書では、様々な実施態様で本発明の原理を説明してきたが、本発明は上述した実施例に限定されず、当業者であれば、本明細書の開示に基づき幾多の変形および修正を施すことが可能であり、これら変形および修正されたものも本発明に含まれるものと理解されたい。

例えば、実施態様の検出対象としては、溶液を用いたがこれは一例に過ぎず、 機能性薄膜と何らかの相互作用をもたらすもの、気体、放射線、電磁波、光など であっても本メカノケミカルセンサーで検出、定量などが可能である。

また、実施態様では、機能性薄膜として蛋白質を用いたが、詳細にはタンパク質非晶質膜、蛋白結晶化膜など用いることができ、その他の有機高分子膜、金属膜、無機セラミックス膜なども使用可能である。また、膜以外の棒状、線維状、板状、膜状物質であっても用いることができる。

さらに、測定する機械的特性としては、必要に応じて弾性定数(縦弾性、横弾性、ポアソン比など)、内部減衰定数、自然長の変化(伸縮)など様々なものを 測定可能である。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】 本発明によるメカノケミカル式センサーに使用される一体型微小構造体(検出器本体)の構造を示す図である。
- 【図2】 図1に示した一体型検出器を用いた本発明によるメカノケミカル式センサーの基本構成を示す図である。
- 【図3】 一体型検出器のフローセル部分(水面変動力の低減効果)の構成をさらに詳細に示す図である。
- 【図4】 検出器本体として使用する微小構造体の製造法(フォトリソグラフィ +精密機械加工法)の工程を示す図である。
- 【図5】 ESD法を利用して本発明で使用する検出器本体に機能性薄膜を形成する方法を示す模式図である。
- 【図6】 カンチレバー(片持梁)の表面に機能性薄膜を形成した微小構造体を 用いたメカノケミカル式センサーの構成を示す図である。
- 【図7】 本発明によるメカノケミカル式センサーで α lactal buminを検出したときの検出シグナルを示すグラフである。
 - 【図8】 蛋白質薄膜を形成しない状態での同様の実験結果を示すグラフである

【符号の説明】

10 検出器本体

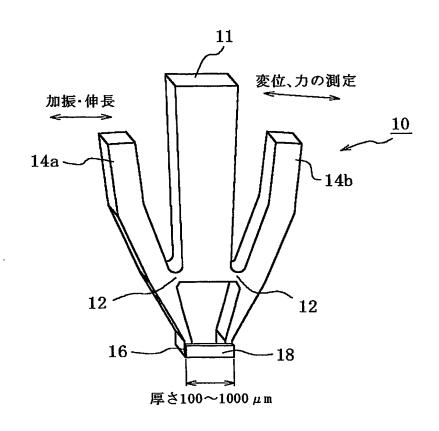
ページ: 15/E

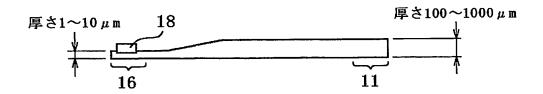
- 11 支持部
- 12 弾性ヒンジ
- 14a, b アーム
- 16 薄膜形成領域
- 18 機能性薄膜
- 100 メカノケミカル式センサー
- 110 ベース
- 120 検出器取り付け部
- 130 一体型検出器(検出器本体)
- 140 微小力センサー
- 150 圧電アクチュエータ
- 152 微動ステージ
- 160 フローセル
- 134a, b 7-A
- 136 薄膜形成領域
- 138 機能性薄膜



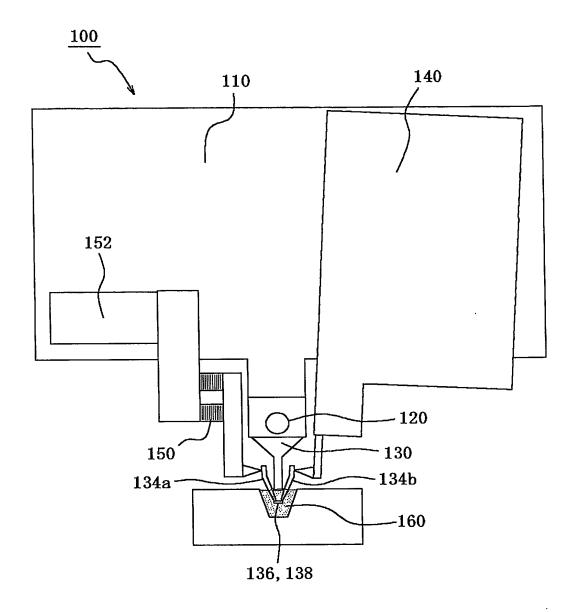
図面

【図1】

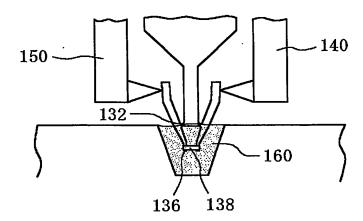




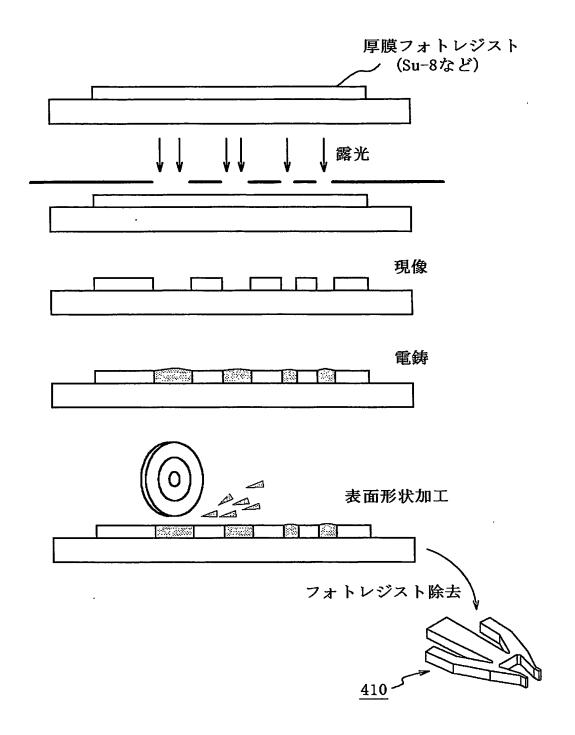




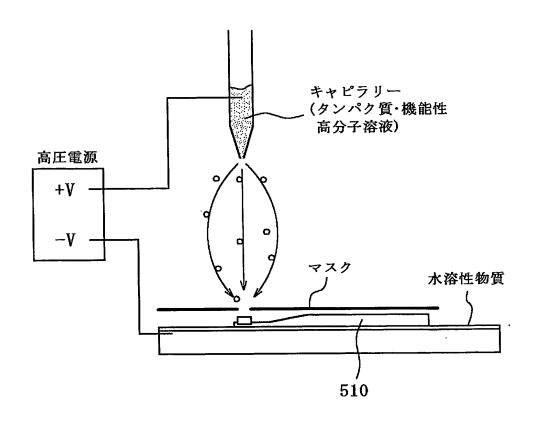
【図3】



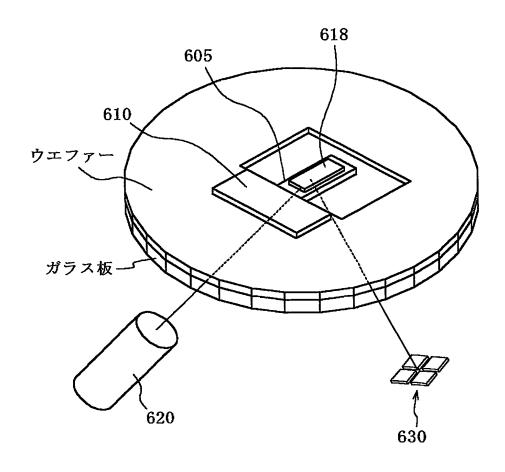
【図4】



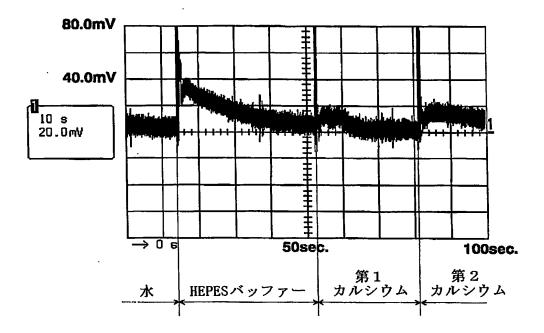




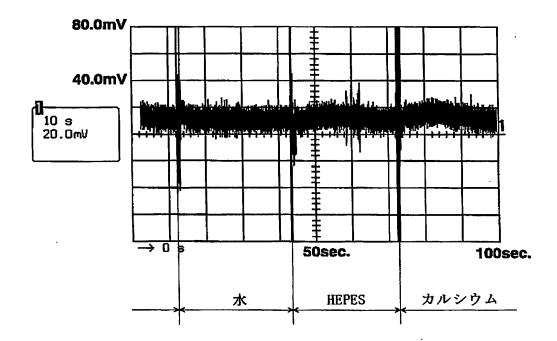
【図6】



【図7】



【図8】



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 検出用の薄膜を一体化した微小構造体を具えるメカノケミカル式センサーを提供する。

【解決手段】その表面の少なくとも一部に機能性薄膜が形成されている微小機械構造体と、前記微小機械構造体を支持する支持手段と、前記微小機械構造体の機械的物性変化を検出する検出手段とを具えることを特徴とするメカノケミカル式センサー。予め機能性薄膜が一体化して形成された微小機械構造体を使用するため、機能性薄膜と微小構造体との接合強度が高く、より高い検出シグナルが得られ、より測定精度や測定感度を向上させることができる。

【選択図】 図2

ページ: 1/E

【書類名】 出願人名義変更届(一般承継)

 【提出日】
 平成15年12月 1日

 【あて先】
 特許庁長官殿

【事件の表示】

【出願番号】 特願2003-204075

【承継人】

【識別番号】 503359821

【住所又は居所】 埼玉県和光市広沢2番1号 【氏名又は名称】 独立行政法人理化学研究所

【承継人代理人】

【識別番号】 100075812

【弁理士】

【氏名又は名称】 吉武 賢次

【提出物件の目録】

【物件名】 権利の承継を証明する書面 1

【援用の表示】 平成15年11月20日提出の特許第1575167号外98件

にかかる一般承継による特許権の移転登録申請書

【物件名】 登記簿謄本 1

【援用の表示】 平成15年11月20日提出の特許第1575167号外98件

にかかる一般承継による特許権の移転登録申請書

【物件名】 委任状 1

【物件名】

委任状

【添付書類】 包含

委 任 状



私は、

識別番号 100075812 弁理士 吉 武 賢 次 氏を代理人と定めて下記事項を委任する。

- 9547 1. 別紙目録に記載の特許出願に関する出願人名義変更届をする件
- 2. 上記各項の手線を処理するため復代理人を選任及び解任する件

以上

平成 / 5 年 // 月 / 9 日

目録(1)

```
1.
   特顧昭63-235737
                             特願平07-327372
                          Ы.
2.
   特願平05-044143
                          52.
                             特願平08-000652
3.
   特願平05-127257
                          53.
                             特願平08-026368
4.
   特願平05-127258
                          54.
                              特願平08-030850
5.
   特願平05-213675
                          55.
                             特顧平08-041279
6.
   特願平05-306164
                          56.
                             特願平08-045903
7.
   特願平05-328611
                          57.
                             特顧平08-051604
8.
   特願平05-336746
                          58.
                              特願平08-065715
9.
   特顯平06-035100
                          59.
                              特願平08-070071
10.
   特顯平06-061792
                          60.
                              特願平08-105667
11.
   特願平06-061793
                          61.
                              特願平08-107784
12.
   特願平06-069150
                          62.
                              特願平08-116473
13.
   特願平06-097098
                          63.
                              特願平08-123475
14.
   特願平06-111624
                          64.
                              特顯平08-127005
15.
   特願平06-121100
                          65.
                              特願平08-131746
16.
   特願平06-145908
                          66.
                              特願平08-132846
17.
   特顯平06-158670
                          67.
                              特願平08-132854
18.
   特願平06-158671
                          68.
                              特願平08-142676
19.
   特願平06-165751
                          69.
                              特願平08-158078
20.
    特顧平06-165752
                          70.
                              特願平08-167401
21.
    特顯平06-181857
                          71.
                              特願平08-196331
22.
    特願平06-235742
                          72.
                              特願平08-197050
23.
    特額平06-238603
                          73.
                              特顯平08-197051
24.
    特願平06-244764
                          74.
                              特願平08-211946
25.
    特願平06-248486
                          75.
                              特願平08-216506
26.
    特願平06-252942
                          76.
                              特願平08-216508
27.
    特願平06-268723
                          77.
                              特願平08-222352
28.
    特顯平06-293933
                          78.
                              特願平08-231066
29.
    特願平06-301372
                          79.
                              特願平08-233442
30.
    特願平06-323795
                          80.
                              特願平08-236685
31.
    特願平06-324490
                          81.
                              特願平08-251410
32.
    特願平06-507966(7服2002-12420)82.
                              特願平08-262051
33.
    特願平07-007185
                          83.
                              特願平08-302896
34.
    特願平07-069255
                          84.
                              特顧平08-308335
35:
                          85.
    特願平07-082880
                              特願平08-308336
36.
    特願平07-083142
                          86.
                              特願平08-311467
37.
    特願平07-117933
                          87.
                              特願平08-315093
38.
    特願平07-133487
                          88.
                              特顯平08-317622
39.
    特願平07-205141
                          89.
                              特願平08-320241
40.
    特願平07-214659
                          90.
                              特顯平08-506395
41.
    特顧平07-217276
                          91.
                              特顯平09-002295
42.
    特願平07-236185
                          92.
                              特願平0.9-010602
43.
    特願平07-240684
                          93.
                              特願平09-019968
44.
                          94.
    特願平07-249244
                              特顯平09-019969
45.
    特顯平07-259922
                          95.
                              特顧平09-019971
46.
    特願平07-282716
                          96.
                              特願平09-024890
47.
    特願平07-302793
                          97.
                              特願平09~028982
48.
    特願平07-306004
                          98.
                              特願平09-046824
49.
    特顯平07-311711
                          99.
                              特顯平09-049254
50.
    特願平07-311715
                          100.
                              特願平09-053478
```

目録(2)

101.			
747	特願平09-054595	151.	特願平10-045434
102.	特願平09-056654	152.	特願平10-049499
103.	特願平09-057342		特願平10-049867
104.	特願平09-058774	154.	特願平10-051489
105.	特願平09-067611	155.	特願平10-051490
106.	特願平09-074394	156.	特願平10-051491
107.	特願平09-080480	157.	特願平10-051492
108.	特願平09-082965	158.	特願平10-051493
109.	特願平09-091523	159.	特願平10-060740
110.	特願平09-091591	160.	特願平10-060741
111.	特願平09-091694	161.	特願平10-061895
112.	特願平09-096968	162.	特願平10-076139
113.	特願平09-099061	163.	特願平10-085207
114.	特願平09-099109	164.	特顯平10-085208
115.	特願平09-104093	165.	特顯平10-103083
116.	特願平09-119730	166.	特願平10-103115
117.	特願平09-129068	167.	特願平10-103671
118.	特願平09-134525	168.	特願平10-104093
119.	特願平09-147964	169.	特顯平10-113493
120.	特願平09-155364	170.	特願平10-116378
121.	特願平09-159963	171.	特願平10-121456
122.	特願平09-163630	172.	特願平10-127520
123.	特願平09-163631	173.	特願平10-136198
124.	特願平09-171924	174.	特願平10-149603
125.	特願平09-175896	175.	特願平10-150494
126.	特願平09-180423	176.	特願平10-151245
127.	特願平09-189436	177.	特願平10-155838
128.	特願平09-198201	178.	特顯平10-155841
129.	特願平09-208866	179.	特願平10-156104
130.	特願平09-221067	180.	特願平10-156108
131.	特願平09-228345	181.	特願平10-198313
132.	特願平09-230870	182.	特願平10-200280
133.	特願平09-253740	183.	特願平10-217132
134.	特願平09-256795	184.	特顯平10-217180
135.	特願平09-271782	185.	特願平10-222837
136.	特顧平09-291995	186.	特願平10-227939
137.	特願平09-297084	187.	特願平10-229591
138.	特願平09-307627	188.	特願平10-232520
139.	特願平09-308597	189.	特顯平10-232590
140.	特願平09-309848	190.	特願平10-236009
	特願平09-327140	191.	
142.	特願平09-327609	192.	特願平10-238144
143.	特願平09-328742	193.	特顯平10-245293
144.	特願平09-360327	194.	特顯平10-250598
145.	特願平10-002030	195.	特願平10-250611
146.	特願平10-010471	196.	特願平10-252128
147.	特願平10-014152	197.	特願平10-260347
148.	特願平10-015690	198.	特願平10-260416
149.	特願平10-024892	199.	特願平10-268791
150.	特願平10-043335	200.	特願平10-269859

目録(3)

201.	特願平10-272529	251. 特顯平11-135137
202.	特顯平10-280351	252. 特顯平11-135482
203.	特願平10-308533	253. 特願平11-143429
204.	特願平10-309765	254. 特願平11-144005
205.	特願平10-311673	255. 特顧平11-147097
206.	特願平10-311674	256. 特願平11-151099
207.	特願平10-311675	257. 特願平11-166247
208.	特願平10-314856	258. 特顯平11-173839
209.	特願平10-315751	259. 特願平11-179278
210.	特願平10-338896	260. 特願平11-186052
211.		261、 特願平 1 1 - 1 9 3 2 3 5
212.	特願平10-338898	262. 特願平11-224269
213.	特願平10-338899	263. 特願平11-225060
214.	特願平10-352428	264. 特願平11-225832
215.	特願平10-354665	265. 特願平11-225839
216.	特願平10-363297	266. 特願平11-226176
217.	特願平10-363329	267. 特願平11-234800
218.	特願平10-506788	268. 特願平11-240325
219.	特願平10-532832	269. 特願平11-240910
220.	特願平10-535583	270. 特願平11-241737
221.	特願平11-008183	271. 特願平11-242438
222.	特願平11-013380	272. 特顯平11-242490
223.	特願平11-015176	273. 特顧平11-253851
224.	特願平11-031724	274. 特顯平11-260947
225.	特願平11-035776	275. 特願平11-277759
226.	特顯平11-046372	276、 特顯平11-278976
227.	特願平11-055835	277. 特願平11-279324
228.	特願平11-055867	278. 特願平11-281632
229.	特願平11-055930	279. 特願平11-303976
230.	特顧平11-056957	280. 特願平11309616
231.	特顧平11-057381	281. 特願平11-315036
232.	特顧平11-057749	282. 特願平11-321282
233.	特願平11-058103	283. 特顯平11-336079
234.		284. 特願平11-346467
235.		285. 特願平11-354563
236.		286. 特願平11-360274
237.		287. 特願平11-365899
238.		288. 特顯平11-373483
239.		289. 特願平11-510791
240.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	290. 特願平11-515324
	特願平11-081225	291. 特顧2000-001783
242.		292. 特顯2000-005221
243.		293. 特顧2000-009363
244.		294. 特顧2000-010516
245.	· · · · ·	295. 特顧2000-011147
246.		296. 特願2000-011623
247.	to the second control of the second control	297. 特顧2000-016518
248.		298. 特願2000-016622
249.		299. 特願2000-017112
250.	特願平11-130815	300. 特顧2000-018612

目 錄 (4)

301.	特願2000-019195	351. 特願2000-141763
302.	特願2000-019528	352. 特願2000-148843
303.	特願2000-020067	353. 特願2000-152455
304.	特願2000-030321	354. 特顧2000-152469
305.	特願2000-034109	355. 特顧2000-154484
306.	特願2000-039082	356. 特顧2000-161895
307.	特願2000-040355	357. 特顧2000-161898
308.	特願2000-041927	
309.	特願2000-041929	
310.	特願2000-041329	
311.	特願2000-045855	
312.	特願2000-051488	
313.	特顧2000-051650	362. 特願2000-184295 363. 特顯2000-191007
314.	特顧2000-052040	
315.	特願2000-052040	
316.	特願2000-054949	365. 特願2000-192332 366. 特顧2000-193817
317.	特顧2000-056093	
318.	特顧2000-056879	
319.	特願2000-057564	368. 特願2000-196991 369. 特願2000-197022
320.	特顧2000-057565	370. 特願2000-197022
321.	特顧2000-057566	371. 特願2000-202801
322.	特願2000-058133	372. 特願2000-210437
323.	特顧2000-058282	373. 特顧2000-224970
324.	特顧2000-062316	374. 特顧2000-225486
325.	特顧2000-064142	375. 特願2000-225864
326.	特顧2000-064209	376. 特顧2000-225978
327.	特願2000-071119	377. 特顧2000-226361
328.	特顧2000-076122	378. 特願2000-229191
329.	特顧2000-085874	379. 特願2000-230551
330.	特願2000-089078	380. 特顧2000-237165
3 31.	特願2000-092693	381. 特願2000-237166
332.	特願2000-100395	382. 特願2000-237533
333.	特願2000~105139	383. 特顯2000-246309
334.	特顯2000-105917	384. 特願2000-248331
335.	特顧2000-107180	385. 特顯2000-249232
336.	特願2000-108409	386. 特願2000-256149
337.	特願2000-109638	387. 特願2000-257080
338.	特願2000-109954	388. 特顯2000-257083
339.	特願2000-118361	389. 特願2000-260030
340.	特願2000-120874	390. 特顧2000-261233
341.		391. 特顧2000-264743
342.	特願2000-128431	392. 特顧2000-265344
343.	特願2000-131049	393. 特願2000-278502
344.	特願2000-131050	394. 特顧2000-279557
345.	特願2000-131745	395. 特願2000-292422
346.	特願2000-134427	396. 特顯2000~292832
347.	特願2000-136551	397. 特願2000-299812
348.	特顧2000-136572	398. 特願2000-307464
349.		399. 特願2000-308248
350.	特願2000-141566	400. 特願2000-309581

目録(5)

401	供幣0000 010 = =	ara abendo e e e e e e e e e
401.	特願2000-319775	451. 特願2001-071435
402.	特願2000-322056	452. 特顧2001-072650
403.	特願2000-333311	453. 特願2001-072668
404.	特顧2000-334686	454. 特顧2001-072963
405.	特顧2000-334969	455. 特願2001-073028
406.	特願2000-343912	456. 特願2001-074964
407.	特願2000-347398	457. 特顧2001-074965
408.	特願2000-347865	458. 特願 2 0 0 1 - 0 7 7 2 5 7
409.	特願2000-358121	459. 特顧2001-077257
410.	特願2000-368566	
411.	特願2000-374626	11201
412.	特顯2000-374020	461. 特願2001-089541
413.		462. 特願2001-091911
	特願2000-378421	463. 特願2001-092337
414.	特願2000-378942	464. 特願2001-116171
415.	特願2000-378950	485. 特願2001-124294
416.	特願2000-384771	466. 特願2001-124452
417.	特願2000-387016	467. 特顯2001-127575
418.	特願2000-394815	468. 特願2001-127576
419.	特願2000-396445	469. 特願2001-135357
420.	特顧2000-399940	470. 特願2001-137087
421.	特顧2000-400336	471. 特願2001-138103
422.	特願2000-401110	472. 特願2001-142583
423.	特願2000-401245	473. 特願2001-147081
424.	特願2000-401258	474. 特願2001-152364
425.	特願2000-503838	475. 特願2001-152379
426.	特願2000-571733	476. 特願2001-153447
427.	特願2000-571943	477. 特顧2001-155572
428.	特顧2000-602588	478. 特顧2001-163740
429.	特顯2000-602900	479. 特願2001-164819
430.	特願2000-618709	480. 特願2001-164997
431.	特顯2001-003476	481. 特願2001-165133
432.	特顧2001-005615	482. 特願2001-167910
433.	特願2001-007979	483. 特願2001-168784
434.	特願2001-016626	484. 特願2001-171705
435.	特願2001-025030	485. 特願2001-173331
436.	特顧2001-037141	486. 特顧2001-174421
437.	特願2001-037147	487. 特願2001-174553
438.	特願2001-042501	488. 特願2001-175898
439.	特顯2001-044933	489. 特願2001-178169
440.	特願2001-047762	490. 特顧2001-179858
441.		491. 特願2001-180552
442.	特願2001-053550	492. 特願2001-180554
443.	特願2001-054717	493. 特願2001-187735
444.	特願2001-059115	494. 特願2001-187,35
445.	特顧2001-059892	495. 特顯2001—19718日
446.	特願2001-060848	496. 特顧2001-197897
447.	特願2001-062703	
448.	特願2001-062703	
449.	特願2001-065917	498. 特願2001-202971
		499. 特願2001-203089
450.	特願2001-068285	500. 特願2001-206505

目録(6)

501.	特願2001-206522	551. 特願2001-325367
502.	特願2001-206523	552. 特願2001-326872
503.	特願2001-209305	
504.	特願2001-212947	
505.	特願2001-216505	
506.	特顧2001-220219	555. 特願2001-332168 556. 特顧2001-337467
507.	特顧2001-226176	557. 特願2001-337467
508.	特顧2001-228287	
509.	特願2001-228374	
510.	特願2001-235412	559. 特願2001-346035 560. 特顧2001-347316
511.	特顧2001-235747	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
512.	特願2001-238951	
513.	特顯2001-236931	562. 特願2001-349614
514.	特願2001-241023	563. 特顧2001-351730
515.	特願2001-246642	564. 特願2001-352189
516.	特願2001-249976	565. 特願2001-353038 566. 特願2001-358446
517.	特願2001-254377	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
518.	特願2001-254378	
519.	特願2001-255589	568. 特願2001-359710 569. 特顧2001-374928
520.	特願2001-256576	570. 特顧2001-374928
521.	特願2001-257188	571. 特願2001-378757
522.	特願2001-261158	572. 特願2001-380473
523.	特願2001-266004	573. 特顧2001-382537
524.	特願2001-266069	574. 特願2001-382539
525.	特願2001-266454	575. 特願2001-382599
526.	特願2001-267194	576. 特顧2001-385258
527.	特願2001-267379	577. 特顧2001-385512
528.	特顯2001-267863	578. 特願2001-385513
529.	特願2001-272977	579. 特顧2001-385538
530.	特願2001-273964	580. 特願2001-388116
531.	特願2001-276053	581. 特顧2001-390122
532.	特願2001-279406	582. 特顧2001-392087
533.	特願2001-280319	583. 特願2001-392088
534.	特顯2001-285145	584. 特願2001-395196
535.	特願2001-291059	585. 特願2001-396120
536.	特顧2001-292223	586. 特願2001-397762
537.	特願2001-292224	587. 特願2001-397998
538.	特願2001-293000	588. 特願2001-401139
539.	特願2001-293054	589. 特顧2001-515803
540.	特願2001-293936	590. 特願2001-523852
541.	特願2001-294013	591. 特顧2001-557672
542.	特顯2001-298140	592. 特顧2002-000993
543.	特願2001-298402	593. 特願2002-005746
544.	特願2001-307340	594. 特額2002-010344
545.	特願2001-309501	595. 特願2002-011558
546.	特願2001-309508	596. 特願2002-019752
547.	特願2001-309984	597. 特願2002-020329
548.	特願2001-310554	598. 特顧2002-022499
549.	特顧2001-313430	599. 特願2002-028046
550.	特願2001-319360	600. 特顧2002-028109

目録(7)

	HIE	anta distributa a a a
601.	特願2002-040151	651. 特顯2002-162157
602.	特願2002-042829	652. 特願2002-162211
603.	特顯2002-044340	653. 特顧2002-162365
604.	特顯2002-044640	654. 特顧2002-167759
605.	特顧2002-046188	655. 特顧2002-170068
606.	特願2002-047799	
607.	特願 2 0 0 2 - 0 5 3 1 9 0	
		657. 特願2002-176435
608.	特願2002-053575	658. 特願2002-176583
609.	特願2002-055272	659. 特願2002-183722
610.	特願2002-057253	660. 特願2002-185966
611.	特顯 2 0 0 2 - 0 5 7 5 6 5	661. 特願2002-187362
612.	特願2002-057935	662. 特願2002-187957
613.	特願2002-057963	663. 特願2002-188281
614.	特顯2002-066249	664、特願2002-189265
615.	特願2002-070624	665. 特顧2002-194627
616.	特願2002-070987	666. 特顧2002-197812
617.	特顧2002-071924	
618.	特顧2002-071924	
619.		668. 特願2002-201575
	特願2002-078164	669. 特願2002-202118
620.	特願2002-081467	670. 特願2002-205814
621.	特願2002-081502	671. 特願2002-205825
622.	特願2002-083081	672. 特願2002-217714
623.	特顧2002-084139	673. 特願2002-221188
624.	特願2002-085017	674. 特願2002-225469
625.	特願2002-087342	675. 特顯2002-225724
626.	特顯2002-094681	676. 特顧2002-226859
627.	特願2002-095132	677. 特願2002-227286
628.	特願2002-095389	678. 特額2002-229686
629.	特願2002-100431	679. 特願2002-230562
630.	特願2002-106561	680. 特願2002-235294
631.	特願2002-119320	681. 特願2002-235737
632.	特願2002-120371	682. 特顧2002-236838
633.	特願2002-123347	683. 特顧2002-237058
634.	特願2002—128854	684. 特額2002-237030
635.	特顧2002-133717	685. 特顯2002-237092
636.	特願2002-133749	
637.	特願2002-134313	
638.		687. 特願2002-253689
	特願2002-141187	688. 特願2002-253697
639.	特願2002-141438	689. 特願2002-254096
640.	特願2002-142260	690. 特顯2002-257924
641.		691. 特顧2002-260788
642.	特願2002-149931	692. 特顧2002-261499
643.	特願2002-150541	693. 特顧2002-264969
644.	特願2002-154688	694. 特顧2002-267114
645.	特願2002-154695	695. 特願2002-268987
646.	特願2002-154823	696. 特願2002-270917
647.		697. 特顧2002-271375
648.		698. 特願2002-271473
649.	特顧2002-160277	699. 特願2002-271473
650.	特願2002-160271	
ond.	TURK 2 U U 2 1 U 2 1 4 0	700. 特願2002-274469

目録(8)

701.	特願2002-276051	751. 特願2003-012738
702.	特願2002-282746	752. 特顧2003-012774
703.	特顯2002-286487	753. 特願2003-015968
704.	特願2002-289209	754. 特顧2003-016044
705.	特願2002-295332	755. 特願2003-016940
706.	特願2002-296911	756. 特顧2003-017397
707.	特願2002-299429	757. 特願2003-021499
708.	特願2002-301875	758. 特願2003-024347
709.	特願2002-303838	759. 特願2003-024620
710.	特願2002-312131	760. 特顧2003-025277
711.	特願2002-320102	761. 特顧2003-027647
712.	特顧2002-320704	762. 特願2003-027648
713.	特願2002-325909	763. 特顧2003-031882
714.	特顧2002-325920	764. 特顧2003-032932
715.	特願2002-332232	765. 特願2003-038206
716.	特願2002-339344	766. 特願2003-040642
717.	特願2002-339392	787. 特願2003-043961
718.	特願2002-339541	768. 特顧2003-050153
719.	特願2002-339551	769. 特願2003-050446
720.	特願2002-341195	770. 特願2003-052520
721.	特願2002-343807	771. 特願2003-052602
722.	特願2002-344279	772. 特顧2003-052613
723.	特顧2002-345597	773. 特顧2003-052877
724.	特願2002-347401	774. 特願2003-053023
725.	特顧2002-348760	775. 特願2003-054182
726.	特願2002-349042	776. 特願2003-054798
727.	特願2002-354594	777. 特顧2003-054799
728.	特願2002-357768	778. 特顧2003-054846
729.	特顯2002-357900	779. 特顧2003-054847
730.	特願2002-358019	780. 特願2003-054848
731.	特願2002-358967	781. 特願2003-054849
732.	特願2002-360972	782、 特顧2003-055452
733.	特顧2002-360975	783. 特願2003-056628
734.	特顯2002-368112	784. 特願2003-061426
735.	特願2002-376555	785. 特願2003-063532
736.	特願2002-376774	786. 特顯2003-065013
737.	特願2002-376831	787. 特願2003-071028
738.	特願2002-379214	788. 特顧2003-072979
739.	特願2002-380624	789. 特顧2003-074168
740.	特願2002-381888	790. 特顧2003-076107
741.	特願2002-382170	791. 特願2003-078999
742.	特願2002-383870	792. 特顧2003-079598
743.	特願2002-521644	793. 特願2003-079613
744.	特願2002-532458	794. 特顯2003-082466
745.	特願2002-546564	795. 特顧2003-083318
746.	特顯2002~548185	796. 特願2003-083433
747.	特顧2002-570743	797. 特願2003-083480
748.	特願2003-003450	798. 特願2003-085193
749.	特願2003-012550	799. 特願2003-089026
7 50.	特顧2003-012694	800. 特願2003-090331

目錄(9)

特顧2003-091446 801. 851. **特願2003-127135** 802. 特願2003~092654 852. 特願2003-127150 803. 特願2003-093642 特願2003-128818 853. 804. 特願2003-094272 854. 特願2003-128897 805. 特願2003-094719 855. 特願2003-129347 806. 特願2003-095770 856. 特願2003-131313 807. 特願2003-095884 857. 特願2003-132280 808. 特願2003-095885 858. 特願2003-132605 809. 特願2003-095886 859. 特願2003-132606 810. 特願2003-095904 860. 特願2003-135591 811. 特願2003-097283 861. 特願2003-136445 特願2003-097327 812. 862. 特願2003-139397 813. 特願2003-101917 863. 特願2003-140684 特願2003-104928 814. 864. **特願2003-142303** 815. 特願2003-105362 865. 特願2003-143932 816. 特願2003-107267 866. 特願2003-145221 817. 特願2003-107268 867. 特願2003-145390 818. 特願2003-107647 B68. 特願2003-147820 特願2003-107885 819. 869. 特願2003-150690 820. 特願2003-109575 870. 特願2003-153014 821. 特願2003-115750 871. 特顧2003-153015 822. 特願2003-115793 872. 特顧2003-153016 823. 特願2003-115847 873. 特顯2003-153985 824. 特願2003-115888 特顯2003-154009 874. 特顧2003-15.4841 825. 特願2003-116232 875. 826. 特願2003-116895 特願2003-155397 876. 827. 特願2003-118161 877. 特願2003-155407 特願2003-118186 828. **878.** 特願2003-158017 829. 特願2003-119749 879. 特願2003-161005 830. 特願2003-119930 880. 特願2003-164126 831. 特願2003-120934 881. 特顧2003-170051 832. 特顧2003-121233 882. 特願2003-170324 833. 特願2003-121261 883. 特願2003-170325 834. 特願2003-121273 884. 特願2003-170326 特願2003-121780 835. 885. 特願2003-170327 836. 特願2003-122245 特願2003-170328 886. 837. 特願2003-123984 887. 特顧2003-170329 838. 特願2003-124654 888. 特顧2003-170330 839. 特願2003-124655 889. 特顯2003-170573 840. 特願2003-124826 890. 特願2003-171576 841. 特願2003-124829 891. 特顧2003-171619 842. 特願2003-124833 892. 特願2003-172898 843. 特顧2003-124835 893. 特願2003-175819 844. 特願2003-125388 894. 特顧2003-177298 845. 特願2003-125403 特顯2003-180198 895. 846. 特願2003-125405 896. 特願2003-182958 特願2003-127090 847. 897. 特願2003-192763 特願2003-127093 848. 898. 特顧2003-192775 849. 特顯2003-127109 899. 特願2003-194837 850. 特願2003-127130 900. 特顧2003-197229

目錄(10)

951.

```
901.
   特願2003-198340
902.
   特願2003-204075
   特願2003-205349
   特願2003-205710
905.
   特願2003-206546
906.
   特願2003-207698
907.
   特願2003-207771
   特願2003-207772
908.
909.
   特願2003-207850
910.
   特願2003-270049
911.
   特願2003-271473
912.
   特願2003-272421
913.
   特願2003-275055
   特顯2003-277958
914.
   特願2003-279130
915.
916.
   特願2003-283972
917.
   特願2003-284055
918.
   特願2003-286640
   特願2003-289138
919.
   特願2003-293912
920.
921.
   特願2003-296474
922.
   特願2003-298558
923.
   特願2003-299424
924.
   特願2003-303979
925.
   特願2003-304452
926.
    特願2003-304453
927.
    特願2003-305689
    特願2003-305844
928.
    特願2003-306137
929.
930.
    特願2003-307564
931.
    特願2003-313014
932.
    特願2003-315355
933.
    特顧2003-318801
934.
    特願2003-321497
935.
    特願2003-322948
936.
    特顧2003-324974
937.
    特願2003-326510
938.
    特願2003-327645
939.
    特願2003-327907
940.
    特顧2003-328600
941.
    特願2003-328840
942.
    特願2003-330418
943.
    特願2003-330569
944.
    特顧2003-331848
945.
    特顯2003-332756
946.
    特願2003-333798
947.
    特顧2003-333932
948.
    特顧2003-334036
949.
    特顧2003-334083
950.
    特願2003-336365
```

特願2003-338191

認定・付加情報

特許出願の番号 特願2003-204075

受付番号 20308550895

書類名 出願人名義変更届(一般承継)

担当官 塩原 啓三 2404

作成日 平成16年 3月26日

<認定情報・付加情報>

【提出された物件の記事】

【提出物件名】 委任状(代理権を証明する書面) 1

特願2003-204075

出願人履歴情報

識別番号

[000006792]

1. 変更年月日 [変更理由]

月日 1990年 8月28日 [由] 新規登録

[変更理由] 住 所

埼玉県和光市広沢2番1号

氏 名

理化学研究所

特願2003-204075

出願人履歴情報

識別番号

[302064588]

1. 変更年月日

2002年11月12日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都渋谷区広尾1-11-5-1403

氏 名

株式会社 フューエンス

2. 変更年月日

2004年 3月25日

[変更理由]

住所変更

住 所

東京都渋谷区広尾1-11-2 AIOS広尾ビル703号

氏 名 株式会社 フューエンス

特願2003-204075

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[503359821]

1. 変更年月日

2003年10月 1日

[変更理由]

新規登録

住 所 氏 名

埼玉県和光市広沢2番1号 独立行政法人理化学研究所